

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2004-193333(P2004-193333A)

【公開日】平成16年7月8日(2004.7.8)

【年通号数】公開・登録公報2004-026

【出願番号】特願2002-359389(P2002-359389)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/68

B 25 J 9/22

B 65 G 49/07

【F I】

H 01 L 21/68 F

B 25 J 9/22 A

B 65 G 49/07 C

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月20日(2005.7.20)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】ウェハ位置教示方法および教示用治具ならびにロボット

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

収納容器と処理装置の間あるいは処理装置相互の間で半導体ウェハの搬送を行なうロボットに前記半導体ウェハの位置を教示するウェハ位置教示方法において、

前記収納容器あるいは前記処理装置の半導体ウェハを設置する位置に教示用治具を設置し、

前記教示用治具上の中心軸部に円錐または円錐の特徴を有する形状部を設け、

前記ロボットのハンドの先端に設けた透過式センサで前記円錐部を検出し、

前記円錐部の断面径に基づき、前記教示用治具のZ(高さ)方向を検出することを特徴とするウェハ位置教示方法。

【請求項2】

収納容器と処理装置の間あるいは処理装置相互の間で半導体ウェハの搬送を行なうロボットに前記半導体ウェハの位置を教示するウェハ位置教示方法において、

前記収納容器あるいは前記処理装置の半導体ウェハを設置する位置との関係が明らかになっている位置に、円錐または円錐の特徴を有する形状部を設け、

前記ロボットのハンドの先端に設けた透過式センサで前記円錐部を検出し、

前記円錐部の断面径に基づき、半導体ウェハを設置する位置のZ(高さ)方向を検出することを特徴とするウェハ位置教示方法。

【請求項3】

収納容器と処理装置の間あるいは処理装置相互の間で半導体ウェハの搬送を行なうロボ

ットに前記半導体ウェハの位置を教示する教示用治具において、
前記半導体ウェハと同一の外径を有する大円板部と、
前記大円板部と中心軸を共通にする円錐または円錐の特徴を有する形状部と
を備えたことを特徴とする教示用治具。

【請求項4】

請求項1または2に記載の方法を実施する機能を備えたことを特徴とするロボット。

【請求項5】

請求項3に記載の教示用治具を備えたことを特徴とするロボット。